

【書類名】要約書

【要約】

【課題】

発光、蛍光、燐光等を分光測定装置を用いて測定する際に、測定環境中、特に反応容器周辺の雰囲気中に荷電の偏りが生じることにより測定に与える測定誤差、バックグラウンドが高くなる等の影響を排除し、目的成分を高精度に定量し得る測定方法及びそれに用いられる装置の提供。

【解決手段】

本発明は、反応容器又は／及び測光室の反応容器周辺の雰囲気を経電的に一定にし、当該測光室の当該反応容器中で、試料中の特定成分に起因する化合物のエネルギー変動により生じる光を測定し、その測定値に基づいて試料中の特定成分の量を求めることを特徴とする測定方法、及び化合物のエネルギー変動により生じる光の量を測定する装置であつて、反応容器又は／及び測光室の反応容器周辺の雰囲気を経電的に一定にするための処理をする機構を備えた装置を提供する。

本発明に係る測定方法によれば、分光測定装置を用いて行う試料中の特定成分の測定に於いて、シグナル値の日差変動が起きることや、バックグラウンドが高くなる等の問題を解決し、微量成分を高精度且つ高感度の測定を行うことができる。

【選択図】 なし

特願 2003-270797

ページ : 1/E

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000252300]

1. 変更年月日

1990年 8月 7日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番2号

氏 名

和光純薬工業株式会社